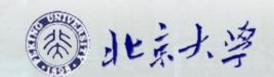


GaN中碳杂质的行为

姓名: 黄华洋

日期: 2021.12.16



报告内容

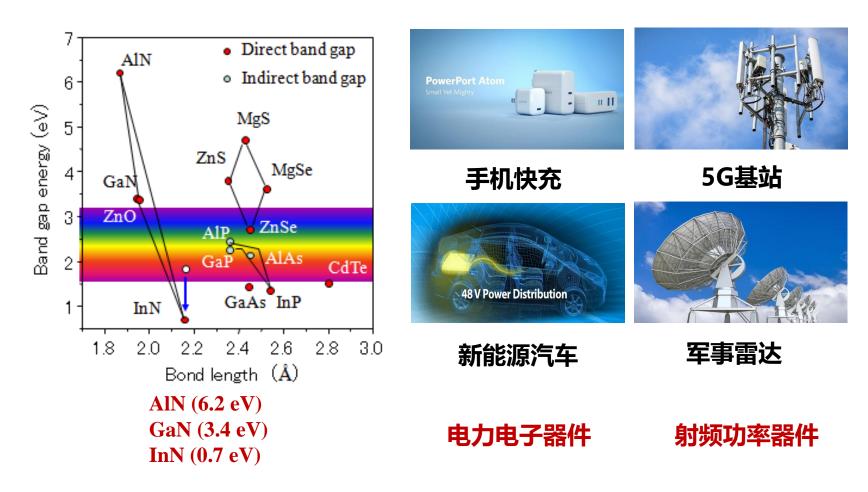
1 GaN基材料及器件的物理基础

2 研究GaN中的C杂质的科学意义

3 GaN中的C杂质相关的研究现状

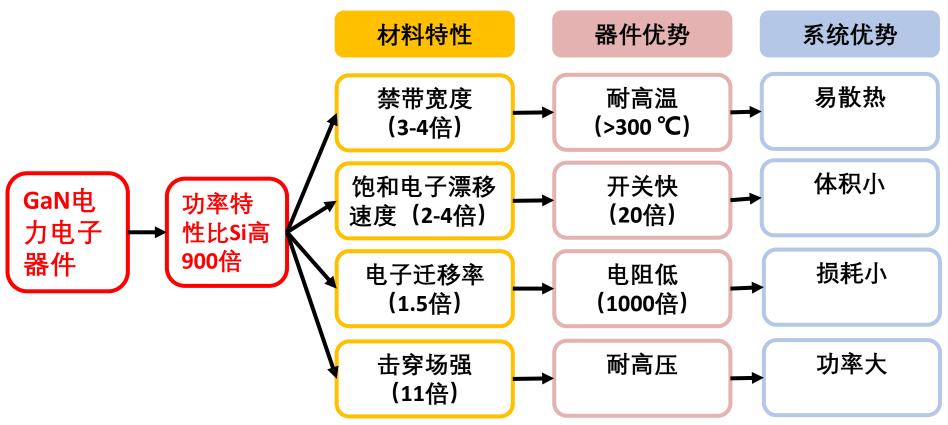
4 总结

氮化镓基电子器件的应用



以氮化物为代表的第三代半导体材料,具有优异的物理化学性质,在电力电子领域和射频领域有着广泛的应用前景。

GaN基电力电子器件的优势



- 更加高效节能
- 使电力电子装置小型化、轻量化、低成本化
- 器件输出功率密度更大(提高晶圆的利用效率)

报告内容

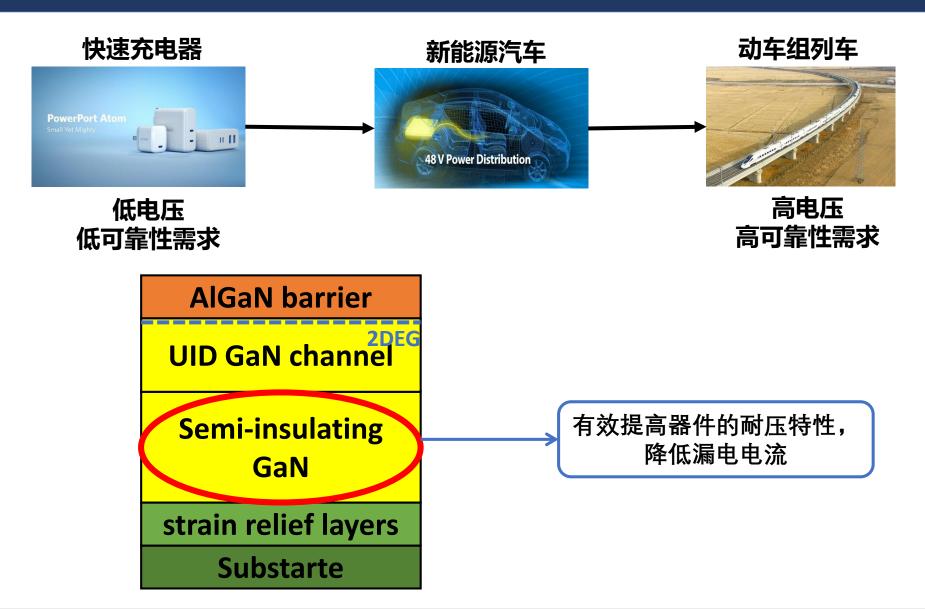
1 GaN基材料及器件的物理基础

2 研究GaN中的C杂质的科学意义

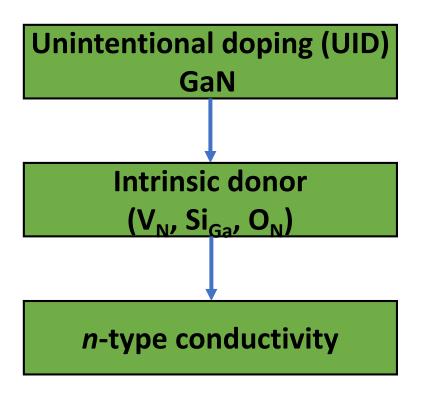
3 GaN中的C杂质相关的研究现状

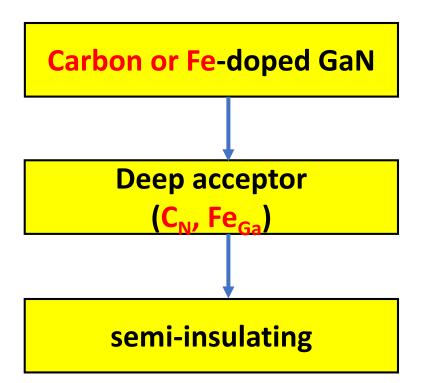
4 总结

GaN基电力电子器件面临的问题:可靠性问题



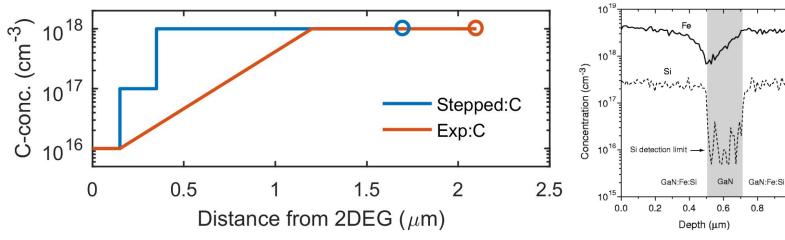
如何获得高阻GaN



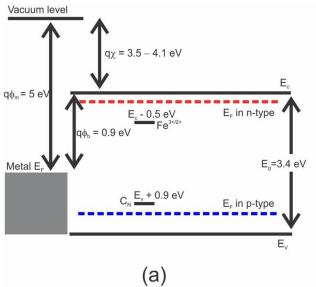


C v.s. Fe

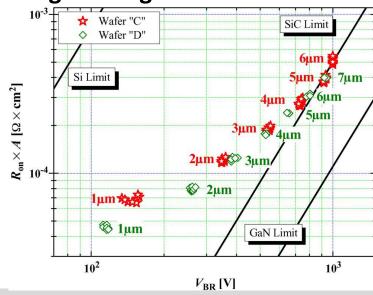
Memory effect



Transition level



Breakthrough Voltage



1.0

J. Appl. Phys. 122, 025704 (2017)
Appl. Phys. Lett. 81, 439 (2002); doi: 10.1063/1.1490396

| BERGSTEN et al.: ELECTRON DEVELOPMENT | BERGSTEN et al.: ELECTRON AIGAN/GAN HEMTS

IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, VOL. 57, NO. 11, NOVEMBER 2010

BERGSTEN et al.: ELECTRON TRAPPING IN EXTENDED DEFECTS IN MICROWAVE AIGAN/GAN HEMTS

击穿电压与C掺杂浓度的关系

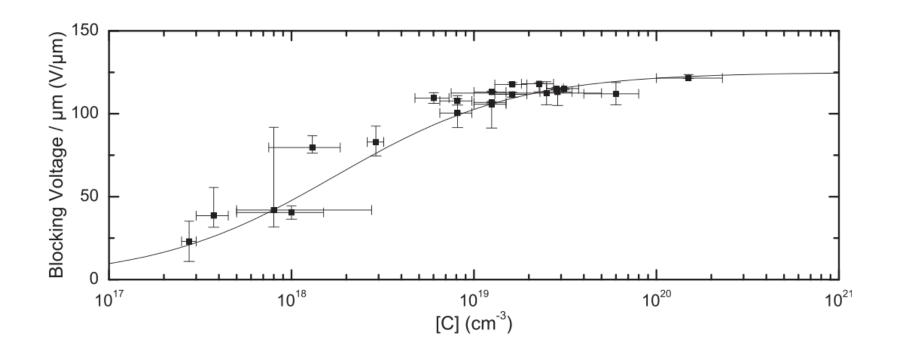
GaN中C杂质的掺杂浓度并不是越高越好。

随着C浓度提高到~2×10¹⁹ cm⁻³,器件的耐压出现饱和。

同时,由于C在GaN内部引入了局域态,器件的可靠性如动

态特性随着C掺杂发生退化。

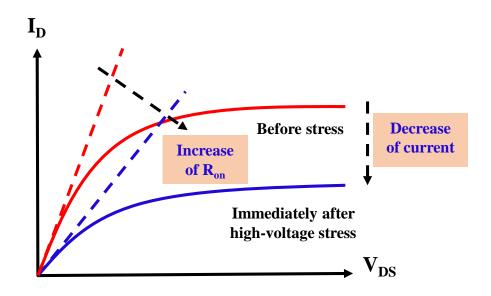
因此,C的掺杂应当有一个最佳范围,以求有效利用C杂质的优势而规避其不利影响。



电流崩塌 (动态导通电阻退化) 问题

电流崩塌,指器件在开态和关态之间快速切换时(在功率电子器件中)或在高频信号下(在微波射频器件中),输出电流突然出现大幅度下降的现象。

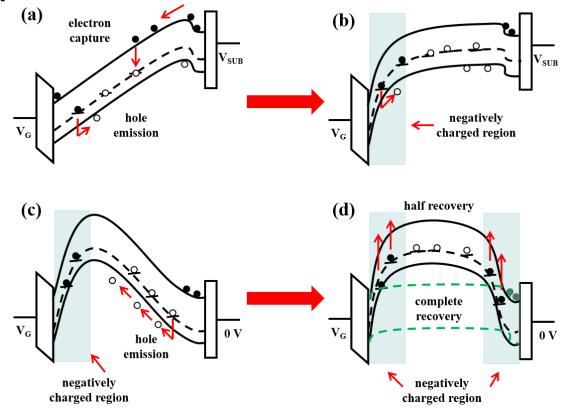
相关表现形式多种多样,例如在功率电子器件中表现为开态电阻增加,并伴随着跨导的下降,因此又称为动态导通电阻退化;在微波射频器件中表现为器件的饱和电流下降,并伴随着阈值电压的正漂。这最终导致器件的输出功率密度和功率附加效率减小、器件性能恶化。



电流崩塌产生机理

电流崩塌是器件在高压应力下,沟道区附近产生了束缚负电荷所致。负电荷使沟道区电势能抬高,沟道电子被耗尽,最终使电流密度降低。

在大的电应力作用下,GaN中的体陷阱态俘获电子,形成负的电荷中心,从而影响沟道附近能带结构并耗尽2DEG。目前国际上认为体陷阱主要与高阻GaN缓冲层中的C掺杂相关,特别是C杂质产生的深能级。



报告内容

1 GaN基材料及器件的物理基础

2 研究GaN中的C杂质的科学意义

3 GaN中的C杂质相关的研究现状

4 总结

MOCVD中C杂质并入机理:自掺杂与外掺杂

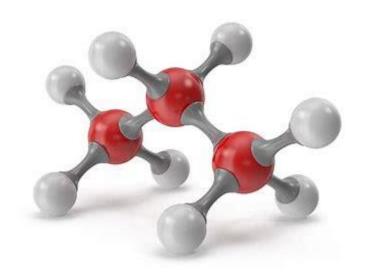
自掺杂方法是用三甲基镓TMGa、三乙基镓TEGa等作为C的掺杂源。

C原子随着Ga原子一起并入到外延层表面,逐渐并入到体内。

通常可以通过调节生长参数如反应室温度、反应室压强和V/III比来调节C杂质的并入浓度。

CH₃ | Ga | H₃C CH₃ 外掺方法需要引入外部C源,如丙烷 (C_3H_8) 等。

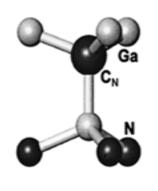
C的掺杂浓度通过外部C源流量进行调控。由于在掺C的同时不需要改变影响GaN晶体质量的生长参数,因此外掺方法的优势为提高C掺杂浓度的同时可以保持较优的GaN生长条件。

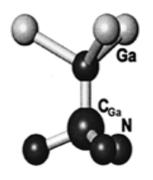


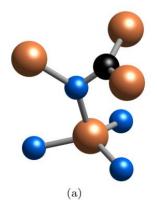
C在GaN中的可能构型

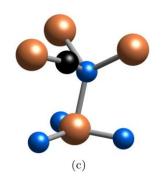
作为两性杂质元素,C在III-V族化合 众中的存在形式可能会非常复杂。

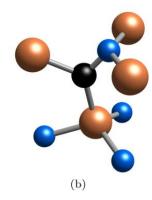


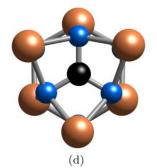










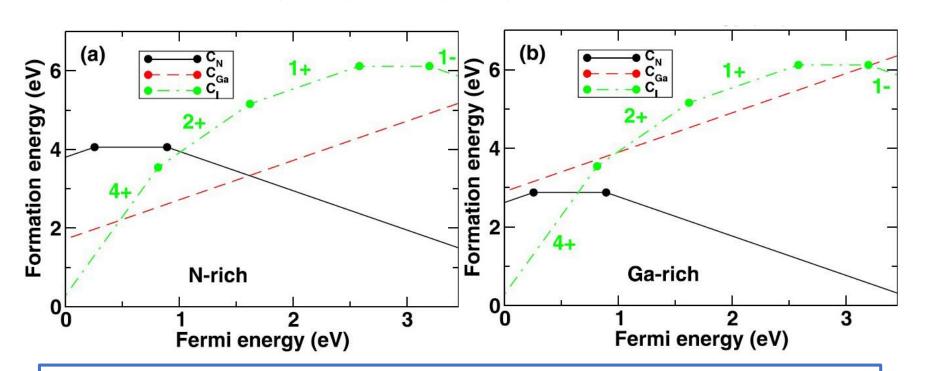


C相关缺陷构型的形成能

转换能级表示缺陷的两种电荷状态形成能相同时的能级。

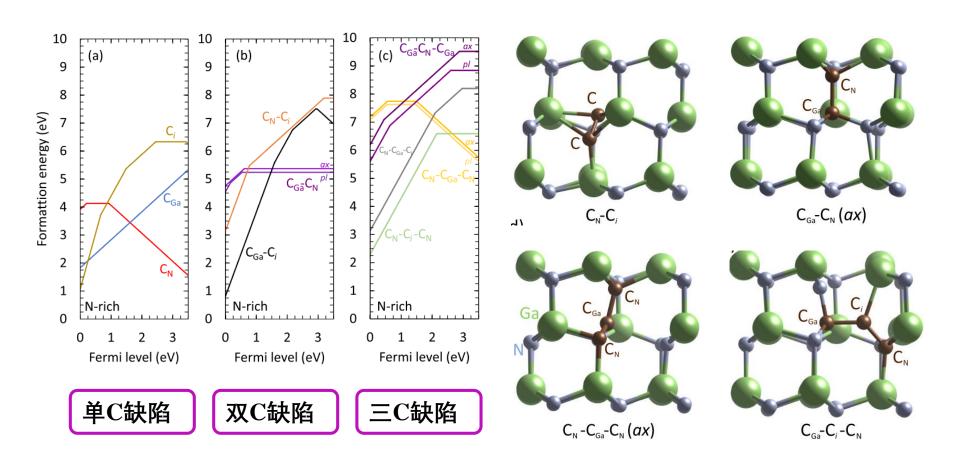
形成能是将杂质原子并入主晶格原子所需要的能量,如对于C杂质在GaN中替代某个晶格位置(N位或Ga位)而言,其形成能表达式为:

$$E^{f}\left(C_{N(Ga)}^{q}\right) = E_{tot}\left(C_{N(Ga)}^{q}\right) - E_{tot}(GaN) - \mu_{C} + \mu_{N(Ga)} + qE_{F} + \Delta^{q}$$



C原子构型与费米能级相关。使得C的替位问题更加复杂!

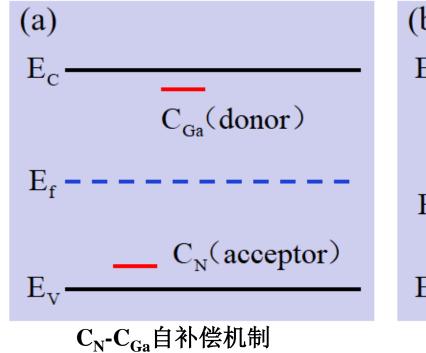
高C掺杂浓度GaN中C的复合构型及其局域态

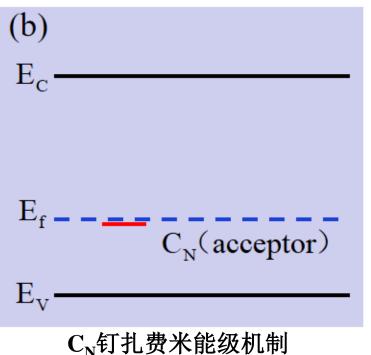


C掺杂GaN高阻形成机理问题

观点1: C_N 是能级位置在价带以上0.2 eV(E_V + 0.2 eV)附近的浅受主, C_{Ga} 为导带以下0.2 eV(E_C - 0.2 eV)附近的浅施主。在通常生长的n型GaN中,C首先替代N位形成浅受主,当费米能级逐渐向价带移动时, C_{Ga} 、 C_I 等不同替位形式对 C_N 形成自补偿。

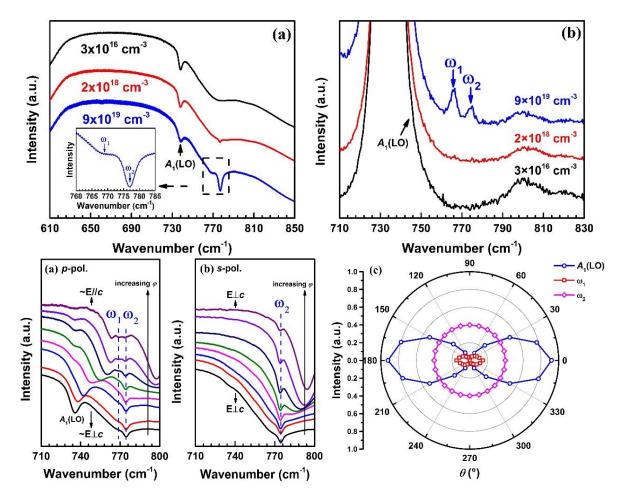
观点2: C_N 实际上为能级位置在 E_V + 0.9 ~ 1.0 eV附近的深受主。他们认为是深受主 C_N 将费米能级(E_f)钉扎在其能级附近,导致了C掺杂GaN的高阻本质,而不是C的自补偿作用。





17

高阻GaN中C杂质的晶格占位:局域振动模研究

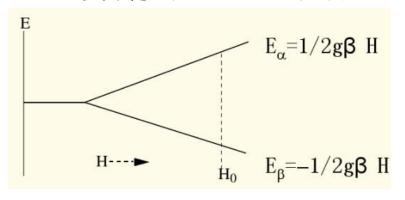


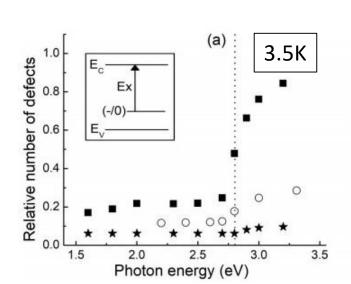
红外和拉曼偏振实验与 第一性原理计算在波数和不 同偏振模式下的振动强度都 十分吻合。

提供了C在GaN中替代N位并以-1价形式存在的直接证据。

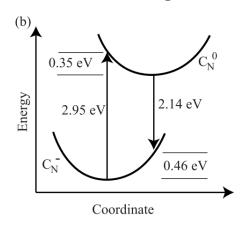
$C_N(-/0)$ 能级实验研究:电子顺磁共振 (EPR)

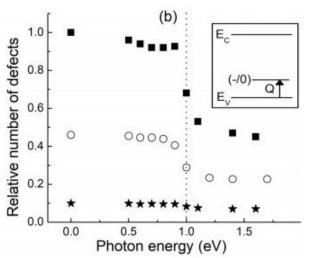
电子自旋磁矩: Zeeman分裂





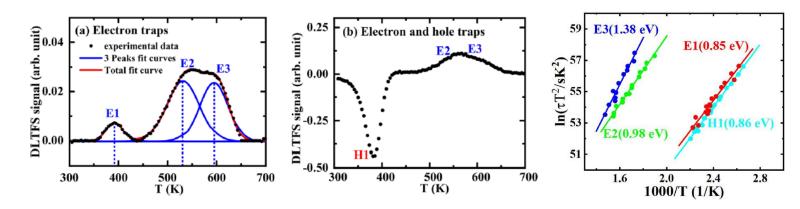
光激发电子跃迁: CC diagram





GaN中CN缺陷的受主态研究

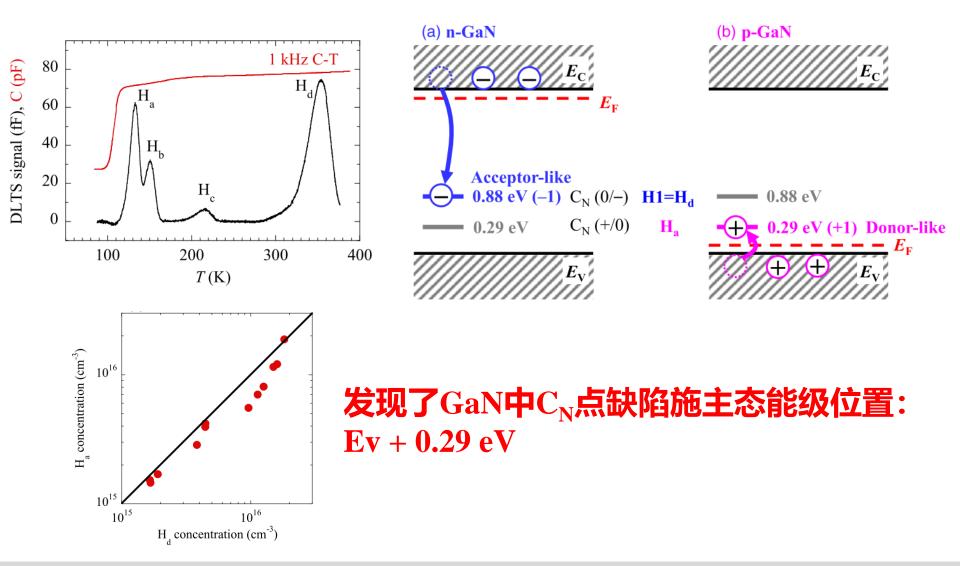
确定了GaN中 C_N 点缺陷受主态能级位置: Ev + 0.86 eV



Trap label	Energy level /eV	σ /cm ²	$N_{\rm T}/{\rm cm}^{-3}$	Defect (transition level)
E1	$E_{C} - 0.85$	3.92×10^{-14}	6.24×10^{14}	Dislocation-related
E2	$E_{\rm C} - 0.98$	5.14×10^{-15}	1.26×10^{15}	$V_{Ga} - O_N (-/2 -)$
E3	$E_{\rm C} - 1.38$	1.74×10^{-14}	1.25×10^{15}	$V_{Ga} - O_N (0/-)$
H1	$E_{ m V} + 0.86$	9.46×10^{-14}	1.10×10^{16}	$C_{N}(0/-)$

通过特殊设计的器件结构,利用高温DLTS确定了GaN中 C_N 点缺陷受主态能级位置,并且确定了它的微观结构和电荷态。

GaN中CN缺陷的施主态研究



报告内容

1 GaN基材料及器件的物理基础

2 研究GaN中的C杂质的科学意义

3 GaN中的C杂质相关的研究现状

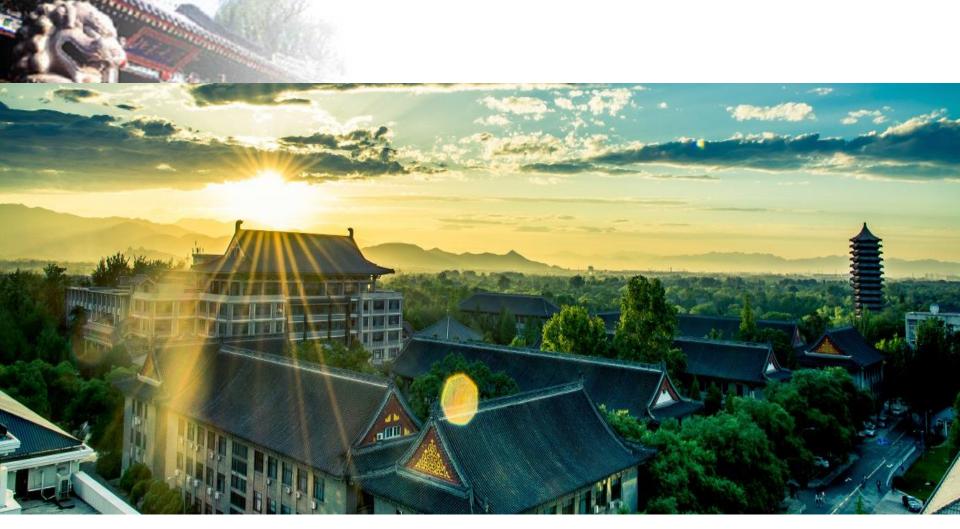
4 总结

总结

GaN基材料在功率电子器件和射频电子器件领域表现出其独特的优势 ,具有重要的研究意义;

C掺杂GaN作为buffer层对于提高器件的耐压,降低漏电具有重要作用,但也会带来一系列的问题,比如电流崩塌效应;

▶ C杂质的并入有自掺杂和外掺杂两种机理; C在GaN中有多种可能的原子构型,并且与浓度,费米能级,生长参数等因素相关; C在半绝缘 GaN被证明是主要替代N位,但是在p型GaN中被预言占据Ga位,目前还存在争议; C_N在GaN中既是受主又是施主,能级位置分别在Ev + 0.86 eV和Ev + 0.29 eV。



谢谢! 恳请陈老师和各位同学 批评指正!